特許協力条約

РСТ

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 FWA5-02	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。			
国際出願番号 PCT/JP2005/002794	国際出願日(日.月.年) 22.02.2005	優先日 (日.月.年) 23.02.2004		
国際特許分類(I P C) Int.Cl. <i>G03B21/14</i> (2006.01), <i>F21S2/00</i> (2006.01), <i>F21V7/09</i> (2006.01), <i>F21V7/10</i> (2006.01), <i>F21V7/10</i> (2006.01), <i>F21V7/10</i> (2006.01)				
出願人(氏名又は名称) シャープ株式会社				

シャープ株式会社					
1. この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。 法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。					
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。					
3. この報告には次の附属物件も添付されている。 a. ※ 附属書類は全部で 3 ~ージである。					
※ 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙(PCT規則 70.16 及び実施細則第 607 号参照)					
第 I 欄 4. 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの 国際予備審査機関が認定した差替え用紙					
b. 電子媒体は全部で (電子媒体の種類、数を示す)。 配列表に関する補充欄に示すように、電子形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。 (実施細則第802号参照)					
4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。					
 第 I 欄 国際予備審査報告の基礎 第 II 欄 優先権 第 II 欄 優先権 第 II 欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 第 IV 欄 発明の単一性の欠如 第 V 欄 P C T 35条(2) に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 					
第VI欄 ある種の引用文献 第VII欄 国際出願の不備 第VII欄 国際出願に対する意見					

国際予備審査の請求書を受理した日 15.12.2005			
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915	特許庁審査官(権限のある職員) 星野 浩一	2 I	8602
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内総	内線 3273	

第 :	[欄	報告の基礎
		Dalling and the state of the st
1.		に関し、この予備審査報告は以下のものを基礎とした。
		出願時の言語による国際出願
		出願時の言語から次の目的のための言語である 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文
		国際調査(PCT規則12.3(a)及び23.1(b)) 国際公開(PCT規則12.4(a))
		3 国際公開(PC I 規則12.4(a) /
		(A) 四所 1 間 日 (T C T) (A) 人(a) (a))
2.		報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出され
	た差	替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)
		出願時の国際出願書類
	5	Hav. A S EINHAVE W
	V	明細書
		第 1 - 2 3 ページ 出願時に提出されたもの
		第 1-23 ページ、出願時に提出されたもの 第 付けで国際予備審査機関が受理したもの
		第ページ*、付けで国際予備審査機関が受理したもの第ページ*、付けで国際予備審査機関が受理したもの
	V	請求の範囲
	39%	
		第項、出願時に提出されたもの第項*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの
		第 1 、 2 、 5 - 1 2 項* 1 7 . 0 3 . 2 0 0 6 付けで国際予備審査機関が受理したもの
		第 項*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの
	(V)	図面
		第 $1-3$ 、 $5-23$ 、出願時に提出されたもの
		第 ページ/図*、15.12.2005 付けで国際予備審査機関が受理したもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの
		第 付けで国際予備審査機関が受理したもの
	<u> </u>	配列表又は関連するテーブル
		配列表に関する補充欄を参照すること。
3.	V	補正により、下記の書類が削除された。
		明細書 第 ページ
		(注) 請求の範囲 第 <u>3、4</u> 項
		第 ページ/図
		配列表(具体的に記載すること)
		配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)
4.		この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超
		えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。 (PCT規則 70.2(c))
		第 ページ
		明細書 第 請求の範囲 第 図面 第 ページ/図
		配列表(具体的に記載すること) 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)
* 4	4. k	に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。

 第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、 それを裏付ける文献及び説明

 1. 見解

 新規性(N)
 請求の範囲
 1、2、5-12
 有 請求の範囲

 進歩性(IS)
 請求の範囲
 1、2、5-12
 有 無

 産業上の利用可能性(IA)
 請求の範囲
 1、2、5-12
 有 無

 産業上の利用可能性(IA)
 請求の範囲
 1、2、5-12
 有 無

2. 文献及び説明 (PCT規則 70.7)

文献1: JP 62-127510 U 文献2: JP 62-127511 U 文献3: JP 11-283422 A 文献4: JP 07-006613 A 文献5: JP 07-028016 A 文献6: JP 03-266824 A 文献7: JP 04-291309 A

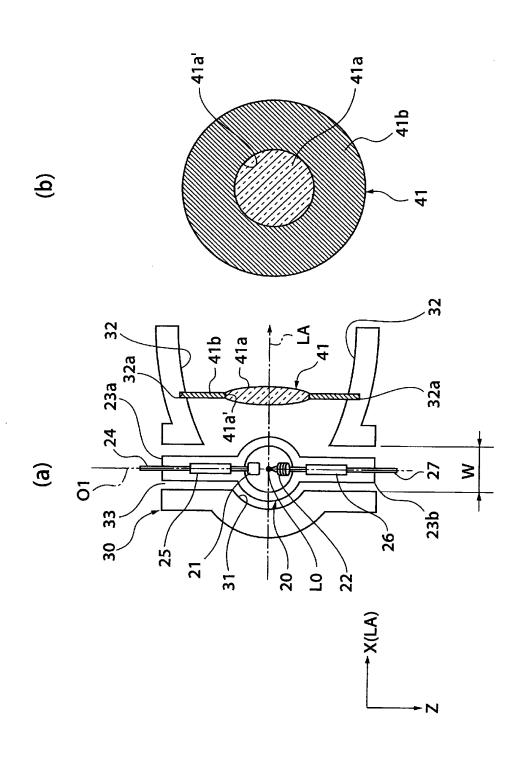
1. 請求の範囲1、2、5-12に係る発明

文献1-7に記載された発明は、リフレクタを備えた光源装置に関するものである。

請求の範囲1、2、5-12に係る発明は、文献1-7により新規性・進歩性を否定されない。

文献1-7には、発光管の電極軸を出射光の光軸と交差させた「密閉型光源装置」において、発光管の後方に球面の金属基材からなる第1リフレクタを、発光管の前方に楕円面の金属基材からなる第2リフレクタを配置するとともに、第2リフレクタの内側に集光レンズを設けることを示唆する記載がない。

[図4]



加工しれた用紙(条約第34条)

請求の範囲

「請求項1]

(補正後)一対の主電極を1本の電極軸上に配置し、それら主電極のリードを封し部で封しした発光管と、この発光管から出射された出射光を反射してその反射光を前方に出射するリフレクタを有しており、それら主電極の電極軸を上記出射光の光軸と交差させた光源装置において、

前記リフレクタを、金属基材を用いて形成し、かつ、発光管のそれぞれの封し部をその熱がリフレクタに伝導するように保持する光源配置用間隙を形成すると共に、発光管を境に後方に発光管の発光点を中心とする球面からなる第1のリフレクタ部と、上記発光管を境に前方に楕円面からなる第2のリフレクタ部とを形成して、これら第1及び第2のリフレクタ部によって発光管の出射光を反射してその反射光を所定の集光点に到達させるように構成するとともに、

前記発光管から前記第2のリフレクタ部以外に向けて出射された出射光を集 光しかつ集光した出射光を所定の集光点に到達させるレンズであって、発光管 近傍の高温雰囲気中で劣化を生じない硝材からなるレンズを第2のリフレクタ 部の内側に設けたことを特徴とする密閉型光源装置。

[請求項2]

(補正後) レンズは、その主点を光軸上にとり、発光管から前方に出射する 出射光線のうち上記第2のリフレクタ部の開口部付近に照射する光線および上 記第2のリフレクタの最内部で反射して集光点に達する光線が交わる点にレン ズの周縁部が位置したものであることを特徴とする請求項1に記載の密閉型光 源装置。

[請求項3]

[請求項4]

「請求項5]

(補正後) 第1のリフレクタ部及び第2のリフレクタ部で反射され、または、レンズで集光されて集光点に到達した発光管の出射光を目的の形状に成形しかつ多重反射にてミキシングすることで光線の面照度を均一化する照度均一化手段を、リフレクタの前端に一体に設けて、リフレクタを密閉構造としたことを特徴とする請求項1または2に記載の密閉型光源装置。

「請求項6]

(補正後) リフレクタは、アルミニウム基材からなり第1のリフレクタ部及び第2のリフレクタ部の反射面上に赤外線成分を熱変換する層と、その熱変換する層上に平坦化層を介して誘電体反射多層膜とを形成して可視光線を所定の集光点に到達させる構成にしたことを特徴とする請求項1、2または5に記載の密閉型光源装置。

「請求項7]

(補正後) 照度均一化手段は、簡状を呈し、リフレクタと同一材質の金属基材からなり、照度均一化手段の金属基材には、赤外線成分を熱変換する層と、その熱変換する層上に平坦化層を介して誘電体反射多層膜とを内面側に形成したことを特徴とする請求項1、2、5または6に記載の密閉型光源装置。

「請求項8]

(補正後)発光管の発光点の両側に主電極のリードを封しした封し部が形成されており、それら封し部とリフレクタとの間に放熱材を配設していることを特徴とする請求項1、2、5~7のいずれかに記載の密閉型光源装置。

「請求項9]

(補正後) リフレクタが、発光管の電極軸を含む軸を境に、第1のリフレクタ部が形成された第1のリフレクタ分割体と第2のリフレクタ部が形成された第2のリフレクタ分割体とに分割できる分割構造になっており、この分割構造の分割面には発光管の封し部を配置する光源配置溝が形成されていることを特徴とする請求項1、2、5~8のいずれかに記載の密閉型光源装置。

[請求項10]

(補正後)リフレクタが、光軸と平行な面で分割できる分割構造になっていることを特徴とする請求項1、2、5 \sim 9 のいずれかに記載の密閉型光源装置

[請求項11]

(補正後) リフレクタを接地し、発光管の封し部の基端側を囲繞するリング 形の補助電極を設け、この補助電極をリフレクタに導通接続したことを特徴と する請求項8に記載の密閉型光源装置。

[請求項12]

請求項1、2、5~11のいずれかに記載の密閉型光源装置を用いていることを特徴とする映像表示装置。